(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-168039

(43)公開日 平成8年(1996)6月25日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	F 1	技術表示箇所
H 0 4 N	5/74	Đ			
G 0 2 F	1/13	5 0 5			
G 0 3 B	21/10	Z			

審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平6-310122

(22)出願日

平成6年(1994)12月14日

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都新宿区西新宿三丁日19番2号

(72)発明者 野村 知義

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 高橋 幸男

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

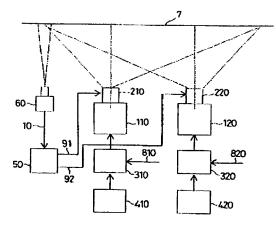
(74)代理人 弁理士 志賀 富士弥

(54) 【発明の名称】 投写型表示システム及び投写位置調整方法

(57)【要約】

【目的】 軽量で高精細化を図るための画素合わせを容易にする投写型表示システム及びその投写位置調整方法を提供する。

【構成】 スクリーン7上に検査パターンを映像信号810、820に合成して2台のプロジェクタ110、120から投写する。この検査パターンの位置をイメージセンサ60で検出し、変位量解析部50においてその検出位置をもとに投写位置の位置ずれを画像処理等により変位量として算出する。この投写位置の変位量に応じて表示位置調整機構部210、220にフィードパックして、その位置ずれを光学的、機械的に自動的に補正する。これにより、高精細化を図るための複数プロジェクタの画素合わせを容易に高精度に行えるようにする。



7…スクリーン

10…イメージセンサ出力信号

50…安位量解析部

60…イメージセンサ

91.92…調整用信号

110. 120…プロジェクタ部

2 I D. 2 2 0 ···表示位置調整機構部 3 1 0. 3 2 0 ···合成映象信号発生部

410,420…検査信号発生部

810,820…映像信号

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の投写型表示装置からの投写画像を スクリーン上で画素重畳する投写型表示システムにおい て、検査パターンを表示するための検査信号を生成する 検査信号発生部と、該検査信号発生部で生成された検査 信号と映像信号を合成する合成信号発生部と、前記スク リーン上に投写された検査パターンの位置を検出する位 置検出部と、該位置検出部により検出された検査パター ンの位置をもとに位置ずれ量を検出する変位量解析部 と、該変位量解析部で検出した位置ずれ量をもとに生成 された信号により前記位置ずれ量がなくなるように前記 投写型表示装置の投写位置を制御する表示位置調整機構 部と、を具備することを特徴とする投写型表示システ 4.

【請求項2】 表示位置調整機構部が、1または複数の 平板透明基板と、投写型表示装置の光軸に対する前記平 板透明基板の角度を制御する駆動部で構成されることを 特徴とする請求項1記載の投写型表示システム。

【請求項3】 表示位置調整機構部が、投写型表示装置 の投写レンズの光軸を移動させる駆動部で構成されるこ 20 とを特徴とする請求項1記載の投写型表示システム。

【請求項4】 表示位置調整機構部が、投写型表示装置 を設置する光学ステージと光学ステージを駆動する駆動 部で構成されることを特徴とする請求項1記載の投写型 表示システム。

【請求項5】 投写型表示装置からの投写画像を反射さ せてスクリーン上に拡大表示するための反射ミラーを設 置し、位置検出部を隣接する投写型表示装置の反射ミラ 一間または反射ミラーの縁部近傍に配置したことを特徴 とする請求項1から請求項4までのいずれかに記載の投 30 写型表示システム。

【請求項6】 複数の投写光学系からの投写画像をスク リーン上で画素重畳する際の投写位置調整方法であっ て、まず、検査パターンを表示するための検査信号のみ を間欠的に発生させて映像信号と合成し、次に、その合 成映像を投写光学系を通してスクリーンに結像し、次 に、前記検査パターンの表示された検出視野の投写像を 結像光学系で結像させ、該結像された検出視野の投写像 を前記問欠的に発生する検査信号に同期して画像信号に 変換し、該変換された画像信号により前記投写光学系の 40 投写位置の位置ずれ量を検出し、該位置ずれ量がなくな るように前記投写光学系の投写位置を自動調整すること を特徴とする投写位置調整方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、大画面表示技術に関 し、詳しくは髙精細画像表示を行う投写型表示システム 及びその投写位置調整方法に関するものである。

[0002]

投写光学系によりスクリーン上に拡大投写する投写型表 示装置の開発が活発である。特にライトバルブに透過型 のアクティブマトリクス形液晶ディスプレイバネル(以 下、TFT・LCDと呼ぶ)を用いた投写型表示装置 (以下、プロジェクタと呼ぶ) は、色再現性、コントラ スト等画質が優れ、手軽に迫力ある大画面が得られるこ とから注目されている。すでに、HDTV表示が可能な 液晶プロジェクタが実現されている。

【0003】図14は従来技術に係わるプロジェクタを 示す原理図である。図14において、1は光源、2は光 源1から発生する赤外線、紫外線をカットするフィルタ ー、3は光学フィルター、4は光源の集光性を高める集 光レンズ、5はライトバルブ、6は投写レンズ、7はス クリーン、mは投写レンズ6の光軸である。

【0004】ライトバルプ5には、通常の液晶テレビと 同様に画信号を入力し画像を表示する。このライトバル プ5に表示された画像を投射レンズ6によってスクリー ン7上に投影表示する。ここで、ライトバルプ5自体は 発光しないため、ライトバルブ5を後部の光源1で照射 し、透過した照射光を投射レンズ6に入射させる。この 結果、ライトバルプ5に形成された表示画像が投射レン ズ6により拡大投影されるため、大画面表示が可能であ

【0005】このような液晶プロジェクタの構成で一層 の解像度を上げるためには、TFT・LCDの画素の高 密度化あるいは表示面積の大形化により画素数を飛躍的 に上げなければならないが、LCDの配線抵抗の低抵抗 化、TFTの駆動能力の向上、製造歩留の低下等が困難 となる。さらに、LCDを駆動するドライバLSIの超 高速化など回路的にも困難となる。このため、従来より 高解像度化を図るために複数のプロジェクタから投写画 像を互いに画素間を埋めるようにしてスクリーン上で重 ね合わせる投写光学系が採用されていた(例えば、特開 昭64-35479号参照)。

【0006】上記の投写光学系の具体的な例を図15に 示す。この例は、上記したプロジェクタを2台配置した 例である。図15において、11、12は光源、21、 22は光源11、12から発生する赤外線、紫外線をカ ットするフィルター、31、32は光学フィルター、4 1、42は集光レンズ、51、52はライトバルブ、6 1、62は投写レンズ、7はスクリーン、m1、m2は 投写レンズの光軸である。

【0007】図15に示すように、ライトバルプ51、 52の画像は、スクリーン7上で重畳されて一つの画像 を形成する。このようなプロジェクタで複数のライトバ ルプ51、52の画像がどのように重畳するかを図16 を用いて説明する。

【0008】図16は4個の画像を重畳する例である。 画像A、B、C、DはライトパルプであるTFT・LC 【従来の技術】最近、ライトバルブに表示された画像を 50 Dの概略図である。1つの画素は光を透過する開口部と

-360-

BNSDOCID: <JP____408168039A__I_>

3

光遮光部からなる。従って、4個の画像A、B、C、D を約半両素ずらして開口部が他の光遮光部に重なるよう に投写すれば、縦横2倍の高精細な画像Eが得られ、高 特細な投写表示が可能となる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたような複数 の画像をスクリーン上で重畳して最大限の解像度を得る ためには、画像のすべての画素の開口部が他の画素の光 遮光部に重畳させる必要がある。従って、すべての投写 画像のピントが合うようなことはもちろん、大きさが同 じであり、歪がなく、スクリーンの回転方向が同じでな ければならない。このため、図17に示すような投写レ ンズの光軸に対してx軸、y軸、z軸、 θx 軸、 θy 軸、 θ z 軸の 6 軸でプロジェクタの投写位置を精密に調 整する必要がある。

【0010】従来、このような調整は、スクリーンに投 写された各プロジェクタの表示位置を定期的に目視で確 認しながら画素ずれを計測して光学ステージェ、y軸等 6軸を手操作で調整する必要があった。さらに、調整す るたびに画面表示を一時中断し、プロジェクタ毎の画素 20 のそれぞれが見分けられるようにドット表示、線画表示 等の検査パターンを表示して画素の表示位置調整をしな ければならないという問題点があった。

【0011】本発明は、上記の問題点を解決するために なされたものであり、その目的は、軽量であり、複数の 画像を重畳する際の画素合わせの容易な調整系を有する 高精細で高品質な投写表示を実現する表示システム及び その投写位置の調整方法を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、複数の投写型表示装置からの投写画像を スクリーン上で画素重量する投写型表示システムにおい て、検査パターンを表示するための検査信号を生成する 検査信号発生部と、該検査信号発生部で生成された検査 信号と映像信号を合成する合成信号発生部と、前記スク リーン上に投写された検査パターンの位置を検出する位 置検出部と、該位置検出部により検出された検査パター ンの位置をもとに位置ずれ量を検出する変位量解析部 と、該変位量解析部で検出した位置ずれ量をもとに生成 された信号により前記位置ずれ量がなくなるように前記 40 投写型表示装置の投写位置を制御する表示位置調整機構 部と、を具備する構成の投写型表示システムを手段とす

【0013】上記の投写型表示システムにおいて、表示 位置調整機構部は、1または複数の平板透明基板と、投 写型表示装置の光軸に対する前記平板透明基板の角度を 制御する駆動部で構成するか、あるいは、投写型表示装 置の投写レンズの光軸を移動させる駆動部で構成する か、あるいは、投写型表示装置を設置する光学ステージ

である。

【0014】また、以上の投写型表示システムにおい て、投写型表示装置からの投写画像を反射させてスクリ ーン上に拡大表示するための反射ミラーを設置し、位置 検出部を隣接する投写型表示装置の反射ミラー間または 反射ミラーの縁部に配置するのが、好適である。

1

【0015】一方、本発明では、複数の投写光学系から の投写画像をスクリーン上で画素重畳する際の投写位置 調整方法であって、まず、検査バターンを表示するため の検査信号のみを間欠的に発生させて映像信号と合成 し、次に、その合成映像を投写光学系を通してスクリー ンに結像し、次に、前記検査パターンの表示された検出 礼野の投写像を結像光学系で結像させ、該結像された検 出視野の投写像を前記間欠的に発生する検査信号に同期 して画像信号に変換し、該変換された画像信号により前 記投写光学系の投写位置の位置ずれ量を検出し、該位置 ずれ量がなくなるように前記投写光学系の投写位置を自 動調整する投写位置調整方法をもう一つの手段とする。

[0016]

【作用】本発明の投写型表示システム及び投写位置調整 方法では、スクリーン上に映像信号とともに投写された 検査パターンの位置をイメージセンサや位置検出素子な どの位置検出部で検出し、その検出位置をもとに投写位 置の位置ずれを画像処理等により解析し、投写位置の位 置ずれ量に応じて表示位置調整機構部にフィードバック して、その位置ずれを光学的、機械的に自動的に補正す ることにより、高精細化を図るための複数の投写型表示 装置の画素合わせを容易に高精度に行えるようにする。

【0017】上記においては、表示画像に検査パターン を合成して表示することで、映像信号の表示中でも自動 調整ができるようにしている。さらに、検査パターン用 の検査信号を間欠的に発生することで、表示画像に重畳 された検査パターンを知覚されずに画素あわせのための 自動調整を行えるようにする。

[0018]

【実施例】以下、本発明の実施例を、図面を参照して詳 細に説明する。

【0019】図1~図4は、本発明の投写型表示システ ムの第1の実施例の構成を説明するための図である。木 実施例は、スクリーンに位置調整用の検査パターンを映 像信号に合成して表示し、この検査パターンを検出して ライトバルブの所定の位置からのずれを検出し、表示位 置調整機構を制御することにより、その位置ずれを補正 する構成例である。

【0020】図1において、110、120は投写型表 示装置(以下、プロジェクタとも記す)、210、22 0は2個の光シフト素子を組み合わせて表示位置を変更 する表示位置調整機構部、310、320は合成映像信 号発生部、410、420は検査信号発生部、50は変 と光学ステージを駆動する駆動部で構成するのが、好適 50 位量解析部、60はイメージセンサ、7はスクリーン、

810、820は映像信号、91、92は調整用信号、 10はイメージセンサ出力信号である。

【0021】検査信号発生部410、420で発生され た検査信号は、合成映像信号発生部310、320で映 像信号と合成されてプロジェクタ110、120に入力 され、各プロジェクタ110、120の表示位置調整機 構部210、220を経てスクリーン7上でプロジェク タ2台の映像を重ね合わせる。イメージセンサ60は、 スクリーン7上で重ね合わされた表示画像を取り込み、 検出視野の光学像を光電変換してイメージセンサ出力信 10 号10を変位量解析部50へ出力する。変位量解析部5 0では、画像処理などにより各プロジェクタ110、1 20の変位量を算出し表示位置調整機構部210、22 0へ各々出力する。このとき変位量解析部50は、2台 のプロジェクタ110、120の動きが最小になるよう に変位量を算出する。

【0022】図2は上記の検査信号と映像信号が合成さ れた表示画像例を示す図である。図2において、7はス クリーンであり、このスクリーン7の4辺に検査パター ンを表示する検査パターン表示領域7a、7b、7c、 7dを設けている。

【0023】図3は検査パターンの概略説明図であり、 図4は投写型表示装置の表示位置調整機構部をいかに駆 動するかを説明するための構成図である。説明を簡単に するために、投写型表示装置を2台とした場合で説明す る。

【0024】投写型表示装置は、図2に示したようにス クリーン?に、位置調整用検査パターンを映像信号に合 成して表示し、検査パターン表示領域7a、7b、7 c、7dに表示された検査パターンを図1のイメージセ 30 ンサ60で撮影する。

【0025】図4において、変位量解析部50内の50 aはイメージセンサ60で撮影された検査パターンから 7a、7b方向のピントを検出し変位量y、θxを算出 する回路であり、変位量y、 θ x をもとに表示位置調整 機構部 (この例では210) のy軸、θ x軸のアクチュ エーター20b、20dを制御する。同様に50bはイ メージセンサ60で撮影された検査パターンから7c、 7 d 方向のピントを検出し変位量 θ z を算出する回路で あり、変位量 θ z をもとに表示位置調整機構部の θ z 軸 40 のアクチュエーター20fを制御する。50cはイメー ジセンサ60で撮影された検査パターンから x 軸方向の ずれを検出する回路であり、検出結果をもとに表示位置 調整機構部のx軸のアクチュエーター20aを制御す る。50 dはイメージセンサ60で撮影された検査パタ ーンから z 軸方向のずれを検出する回路であり、検出結 果をもとに表示位置調整機構部のえ軸のアクチュエータ -20cを制御する。50cはイメージセンサ60で撮 影された検査パターンからθy方向の回転ずれを検出す る回路であり、検出結果をもとに表示位置調整機構部の 50 θy軸のアクチュエーター20eを制御する。

【0026】ピントの検出は、例えば検査パターン領域 に表示された検査パターンから矩形画像を抽出し、矩形 の縦、横のサイズを計測する。この抽出した矩形の形状 が最小になるように表示位置調整機構部を調整すること でピント調整ができる。

6

【0027】x、z軸方向のずれ検出は、図3に示す検 査パターン例を用いる以下の方法で行うことができる。 図3(a)は検査パターン表示領域7aに表示された十 字パターンを示している。 z 軸方向のずれは、予め設定 した十字型の基準線の横方向のずれ量Szを計測して行 い、このずれ量がゼロになるようにフィードバックして 表示位置調整機構部を制御する。x軸方向のずれ量は、 図3(b)に示すスクリーン7cに表示された検査パタ ーンから検出する。すなわち、検査パターンと予め設定 した基準線の縦方向の線のずれ量Sxを計測し、このず れ量がゼロになるようにフィードバックして表示位置調 整機構部を制御する。

【0028】回転ずれ (θy軸) の検出は、スクリーン 検査パターン表示領域7a、7cに表示された十字パタ ーンの縦、横方向と基準線の横線との角度を計測して行 い、この回転ずれがゼロになるようにフィードバックし て表示位置調整機構部を制御する。

【0029】1台の投写型表示装置の表示位置調整が終 えたら、この投写型表示装置の表示を基準として他のプ ロジェクタの調整を行う。

【0030】図5は本実施例の表示位置調整機構部の構 成を説明するための模式構成図である。この構成例は、 光シフト素子に片面が斜面であるくさび形透明基板を2 枚用いたものであり、投写レンズの光軸に対して、x 軸、2軸方向の位置調整のためのものである。以下で は、説明を簡単にするために、x軸方向に限定して説明 する。

【0031】図5において、8a及び8bは屈折率がn 1であるくさび形透明基板であり、互いの斜面が図5の ように間隔すの空気層を挟んで平行になるように配置す る。くさび形透明基板8a、8bの斜面の角度は互いに 等しく θ 1とする。いま、くさび形透明基板8aの入射 面、くさび形透明基板 8 b の出射面が光軸に直角である とし、光線が光軸に平行に入射することとする。光線は くさび形透明基板8aの斜面に法線1に対して角度θ1 で入射し、角度 θ 2で屈折して空気層に出射する。この 出射した光線は、くさび形透明基板8bに入射するが、 両者の斜面が平行であるので、法線 2 に対し角度 θ 1 で 再び屈折する。くさび形透明基板8 bを出射した光線 は、光軸と平行に、かつ光軸に対してsだけシフトして 出射する。このときのシフト量 s は屈折の法則より式 (1) となる。

[0032]

$s = d * \theta 1 (n 1 - 1)$

従って、くさび形透明基板8a、8bの間隔dを可変し、さらにy軸を中心に両基板を回転させれば、x-zの2軸で光軸をシフトできる。

【0033】図6は光シフト素子を適用した投写型表示 装置の光学系の構成例を示す図である。本構成例は、投 写レンズの光軸に対して、x軸方向すなわちスクリーン 面の左右方向と、2軸方向すなわちスクリーン面の上下 方向(紙面に対して垂直な方向)の位置調整のための構 成であり、位置調整のための光シフト素子として、平行 透明基板を用いたものである。以下、説明を簡単にする ために、x軸方向に限定して説明する。

【0034】図6において、7はスクリーン、11、12は光源、21、22は光源11、12から発生する紫外線、赤外線をカットするフィルター、31、32は光学フィルター、41、42は集光レンズ、51、52はライトパルブ、61、62は投写レンズ、81、82はスクリーン7と投写レンズ61、62の間に配置した平板透明基板である。m1、m2は投写レンズ61、62の光軸、m11、m12は平板透明基板81、82から2の出射される光線である。

【0035】ライトバルブ51、52の画像は、投写レンズ61、62により拡大された像としてスクリーン7上に結像される。平板透明基板81、82は、光軸m1、m2に対して2軸を中心に互いに逆方向に回転する。従って、平板透明基板81、82を配置したときは、ライトバルブ51、52からの光線は屈折して図中矢印(光軸m1、m2)の方向にシフトする。従ってライトバルブ51、52の中心は等価的にそれぞれm11、m22の方向にシフトしたことになる。このとき、ライトバルブ51、52の画像は、投写レンズ61、62の結像の原理により、スクリーン7上では、各々矢印と同方向に移動する。スクリーン7上で結像された像の移動距離は、結像の原理によりS倍(投写倍率)である。

【0036】なお、平板透明基板は、上記のように投写レンズ61、62の出射側に配置する以外に、投写レンズ61、62の入射側に配置したり、投写レンズ61、62の入射側と出射側の両方に配置したりしてもよい。

【0037】図7は本実施例における表示位置調整機構 40 部の構成例を示す図である。

【0038】光学素子100aと100bは同一の構成であり、光学素子100aは、屈折率n1の平板透明基板102a、102b及び平板透明基板102a、102bと同じ屈折率n2(=n1)を有する透明液体103で構成され、2枚の平板透明基板102a、102bで透明液体103を挟持し、蛇腹構造のシール材104で封止する。光学素子100bは、屈折率n1の平板透明基板102c、102dと同じ屈折率n2(=n1)を有する透明液体50

... (1)

103で構成され、透明液体103は光学素子100a と同様に蛇腹構造のシール材104で封止されている。

8

【0039】光学表了100aと100bは互いの斜面が所定の問隔(d)の空気層を挟んで平行になるように、さらに、斜面の角度は互いに等しく θ 1となるように配置する。平板透明基板102aと102dは光軸m1に対して直角になるように固定する。平板透明基板102aと102b及び102cと102dは、シール材104を介して接続されるため互いの平板透明基板を自由に作動させることができる。すなわち、平板透明基板を自由に作動させることができる。すなわち、平板透明基板102bと102cの平行を保ちながら平板透明基板0なす角度 θ 1を設定する。

【0040】このような光シフト素子を用いた光学的作用は、光学系素子100aを出射した光線は、光学素子100bへ入射され、光軸m1と平行にかつ光軸m1に対してsだけシフトした光線m11として出射させることができる。

【0041】本実施例において、光軸に対する角度 θ 1 の調整は、駆動器108によって行う。駆動器108は、結合子105a、駆動アーム106、マイクロメーター107で構成される。マイクロメーター107が左右方向に動作すると、駆動アーム106が回動され、この駆動アーム106を介して結合子105aが上下方向に連動し、接続された2枚の平板透明基板102b、102cは平行を保ちながら光軸m1に対して角度が変化する。このため、光線11のシフト量をマイクロメーター107の作動距離に応じてシフトすることができる。

【0042】次に、本発明の投写型表示システムの第2の実施例を示す。図8はその第2の実施例を説明するための模式構成図である。

【0043】本実施例は、投写レンズの光軸を移動して、x軸方向すなわち、スクリーン面の左右方向とz軸方向すなわちスクリーン面の上下方向(図面に対して垂直な方向)の投写位置を調整のための構成であり、その位置調整を行うために投写レンズ駆動する表示位置調整機構部を用いたものである。以下、説明を簡単にするために、x軸方向に限定して説明する。また、光学系の構成は、平板透明基板81、82がない点を除いて図6と同様であるので、同一符号を用いることで、その説明を省略する。ただし、2つの光学系の各光源11、12の光軸をm1、m2とし、各光学系から出射される光線をm11、m12とする。

【0044】図9は第2の実施例における表示位置調整機構部の模式構成図である。図9において、200はx2ステージ用台座、300はx軸台座、400はz軸台座、500aはx軸駆動用モーター、500bはz軸駆動用モーター、600aはx軸用ラック、600bはz

20

帕用ラック、700aはx軸用ピニオン、700bはz 軸用ピニオン、800は投写レンズである。

【0045】プロジェクタの表示位置調整機構部を如何 に駆動するかを図8、図9を用いて説明する。図8にお いて、x2ステージ用台座200は、ライトバルブと平 行にかつ光軸m1 (y方向) に対して垂直に配置されて いる。また、投写レンズ800が光軸m1に対してx軸 方向にずれて固定されたとする。屈折の法則により、光 線は投写レンズ61 (または62) に対してある角度で 入射するため、屈折して空気層に出射する。従って、図 9に示すx軸駆動用モーター500aによりx軸用ピニ オン700aを回転し、x軸用ラック600aの取り付 けられたx軸台座300を左右方向に動かすことによっ て、光軸を左右に、すなわちスクリーン?上の表示画面 を変位量解析部で算出される変位量に応じて左右に移動 することができる。ス軸についても、X軸台座300に 取り付けられたる軸駆動用モーター500bによりる軸 用ピニオン700Bを回転し、z軸用ラック600bの 取り付けられた 2 軸台座 4 0 0 を上下方向に動かすこと により、同様に光軸を移動することができる。

【0046】次に、本発明の投写型表示システムの第3 の実施例を示す。図10はその第3の実施例の構成を説 明する模式構成図であり、投写型表示装置の表示位置調 整機構部を如何に駆動するかを説明するための模式図で ある。第3の実施例は、光学ステージ上にプロジェクタ を搭載した構成である。光学系の構成は図6と同様であ るので省略する。ただし、本実施例の光学系では、平板 透明基板は用いていない。

【0047】図10において、1a、1bはプロジェク タ、61、62は投写レンズ、210は表示位置調整機 30 構部、310は合成信号発生部、410は検査信号発生 部、50は変位量解析部、60はイメージセンサ、7は スクリーン、810は映像信号、9a、9b、9c、9 d、9e、9fは圧電素子、10a、10bは光学ステ ージ、11a、11b、11c、11dは変位センサを 示す。また、光学系の構成は、平板透明基板を除いて図 6と同じである。

【0048】図10において、光学ステージ10a上に 搭載されたプロジェクタ1 a は圧電素子9 a 、9 b 、9 c の圧電効果により印加電圧に比例した応力が働き光学 40 ステージ10 a上を移動する。例えば、圧電素子9 aに 入力電圧が印加された場合、光学ステージ10aは図面 の上から下(図10を上から見た図とすれば、x軸方 向) へ移動する。また、圧電素子9bに電圧が印加され た場合、プロジェクタ1aは、図面の右から左(y軸方 向)へ移動される。さらに、光学ステージ10 a あるい はプロジェクタ1aの底部に配置された圧電素子9cに 電圧が印加された場合、プロジェクタ1aは図面に対し 垂直の方向(2軸方向)に移動される。変位センサ11

検出信号は変位量解析部50に入力されて、プロジェク タ1aのx軸、y軸の動き観察用として使用され、変位 量解析を容易にする。

【0049】なお、図面では省略されているが、2軸の 動き観察用の変位センサも配置されている。また、光学 ステージ10 b 上に搭載されたプロジェクタ1 b につい ても、同様に構成され、同様に動作する。

【0050】図11は本発明の第4の実施例を説明する タイムチャートである。本実施例は図6、図8、図10 の実施例のプロジェクタにおいて、スクリーン?に位置 調整用の検査パターンを表示し、この検査パターンを検 出してライトバルブの所定の位置からのずれ量を算出し て、表示位置調整機構部を制御することにより位置ずれ を補正する構成例における検査パターン用検査信号と映 像信号の合成の方法を示す。説明を簡単にするため、2 台のプロジェクタで構成される場合の映像信号に検査信 号を合成する方法を説明する。

【0051】図11において、1000は表示装置の垂 直同期信号波形であり、T1~Tnはその波形が変化す るタイミングである。2000a、2000bは間欠 的、時分割的に発生する検査信号発生部起動信号であ り、3000は映像信号波形であり、4000は検査信 号波形であり、5000a、5000bは合成信号波形 であり、6000a、6000bは検査信号発生部起動 信号と同様に発生するイメージセンサ起動信号である。 上記のタイミングT1~Tnは市販表示装置の1フレー ム周期と同等である。

【0052】次に、映像信号と検査信号の合成方法とプ ロジェクタへの合成信号5000a、5000bの入力 方法、及びスクリーン上の検査パターンをイメージセン サで取り込む方法を説明する。タイミングT1の期間に 検査信号発生部起動信号2000aを発生して映像信号 3000と検査信号4000を合成し、合成信号500 0 a をプロジェクタに入力する。さらに、タイミングT 2の期間に検査信号2000bを発生して映像信号30 00と検査信号4000を合成し、合成信号5000b をもう一方のプロジェクタへ入力する。一方、イメージ センサは、タイミングT1の期間にイメージセンサ起動 信号60000個に同期してスクリーン上の検査パターン を取り込み、タイミングT2の期間にイメージセンサ起 動信号6000bに同期して、スクリーン上の検査パタ ーンを取り込む。

【0053】図12は本発明の第5の実施例の構成を示 す背面投写方式の投写型表示装置の模式構成側面図であ り、イメージセンサの配置方法を示す図である。110 a、110b、110cは反射ミラーであり、110は プロジェクタであり、61は投写レンズであり、60 a、60bはイメージセンサであり、7はスクリーンで あり、130は筐体である。プロジェクタ110の光学 a, 1 1 b はプロジェクタ 1 a の近傍に配置され、その 50 構成は、図 6、8、1 0 と同様であるので説明を省略す

12

る。

【0054】本実施例は、表示装置をコンパクトに構成するため、反射ミラーにより投写光を折り曲げた例である。すなわち、投写レンズ61からの出射光を第1番目の反射ミラー110aで反射し、筐体130の上部に取り付けられた第2の反射ミラー110bで反射し、さらに筐体130の後部に取り付けられた第3の反射ミラー110cで反射し、スクリーン7上に投写する。図2に示す検査パターン表示領域7a、7bの検査パターンを取り込むために、イメージセンサ60aを第3の反射ミラー110cの上部に取り付け、検査パターン表示領域7c、7dの検査パターンを取り込むために、イメージセンサ60bを第3の反射ミラー110cの下部に取り付ける。

【0055】図13は本発明の第6の実施例の構成を示す背面投写方式のプロジェクタの模式側面図(a)と内部模式正面図(b)であり、イメージセンサの別の配置例を示す図である。111、112は2第のプロジェクタに対応させて配置した第1の反射ミラーであり、110は第2の反射ミラーであり、110には第3の反射 20ミラーであり、110はプロジェクタ(ここでは代表して1台だけを示す)であり、61は投写レンズであり、60はイメージセンサであり、7はスクリーンであり、130は管体である。

【0056】投写光の折り曲げ方法は、第1の反射ミラーが2つのミラー111、112で構成されていることを除いて図12の第5の実施例と同様であり、プロジェクタの光学構成は図6、8、10と同様であるので、その説明を省略する。

【0057】本実施例では、図2に示す検査パターン表 30 示領域7a~7dの検査パターンを一つのイメージセンサ60で取り込むために、図13(b)に示すように、第1の反射ミラーを2つのプロジェクタに対応させて2つのミラー111、112で構成してその中間に一つのイメージセンサ60を取り付け、スクリーン7の表示領域の全域を取り込むように配置する。本実施例によればイメージセンサの数を削減できる。

【0058】なお、上記の実施例では、3つの反射ミラーを用いる例を示したが、反射ミラーは1つ以上で構成できる。反射により画像が鏡像となる場合は、ライトバ40ルプを反転して配置するなどの対策を採ればよい。第6の実施例では、第1の反射ミラーとして2つのミラーを用いることにより間隙を作りそこにイメージセンサを配置する例を示したが、1つのミラーの中央近傍に光透過部(閉口穴、ハーフミラー、透明部など)を設けて、その背後にイメージセンサを配置してもよい。また、表示位置調整機構部は、調整する軸別に上記実施例の中から最適なものを選択することにより、上記の各実施例を組み合わせて構成してもよい。また、実施例では、主にx、y、z軸についての自動調整手段を例示したが、650

x. θy、θ z 軸の自動調整も同様に行うことができる。例えば、図6の第1の実施例の場合では、平板透明 基板81、82をアクチュエータで6軸に制御すればよいし、第10図の第3の実施例の場合では、光学ステージをさらに3軸で支える構造として各軸の回転方向のずれ量を圧電素子などのアクチュエータでフィードバック制御すればよい。以上の場合、必ずしも6軸全部を調整する必要はなく、両質に対して影響度の大きい軸を選択して調整できる構成としてもよい。検査バターンの位置検出手段としては、上記のイメージセンサの他に、光学的な位置検出素子を用いることができ、例えばスクリーンの背面などに設置することもできる。

[0059]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の投写型表示システム及び投写位置調整方法によれば、スクリーン上に映像信号とともに投写された検査バターンの位置をイメージセンサや位置検出素子などの位置検出部で検出し、その検出位置をもとに投写位置の位置ずれを画像処理等により解析し、投写位置の位置ずれ量に応じて表示位置調整機構部にフィードバックして、その位置ずれを光学的、機械的に自動的に補正するようにしたので、映像信号の表示中であっても、表示を中断することなく複数の投写型表示装置の画素合わせを容易に高精度に行うことができる。

【0060】上記において、筺体の内部に拡大投写用の反射ミラーと検査パターンの位置検出部を設置した場合には、画素合わせが容易で高精度で行える背面投写型の表示システムがコンパクトに実現できる。この場合、隣接するプロジェクタの反射ミラーの中間に位置検出部を配置することにより位置検出部の数を削減できる。

【0061】さらに上記において、検査パターン信号を 間欠的に発生するようにした場合には、表示画像に重母 された検査パターンが知覚されずに画素合わせのための 自動調整が行うことができる。

【0062】このような表示位置ずれを補正する表示位 置調整装機構部を備えた投写型表示システムを高精細な 大画面表示システム及びマルチプロジェクションシステム等に適用すれば、高精細な位置調整が簡易にできる。

【図面の簡単な説明】

② 【図1】本発明の第1の実施例を示す概略構成図である。

【図2】本発明の第1の実施例に適用する検査パターン表示領域の概略説明図である。

【図3】(a)、(b)は本発明における第1の実施例の検査パターンの概略説明図である。

【図4】本発明の第1の実施例における表示位置調整機構部を駆動するための概略構成図である。

【図 5】本発明の第1の実施例に適用する光シフト紫子の概略説明図である。

【図6】本発明の第1の実施例における投写型表示装置

の概略構成図である。

【図7】本発明の第1の実施例における表示位置調整機 構部の概略構成図である。

【図8】本発明の第2の実施例を示す投写型表示装置の 概略構成図である。

【図9】 本発明の第2の実施例における表示位置調整機 構部の概略構成図である。

【図10】本発明の第3の実施例を示す概略構成図であ

【図11】本発明の第4の実施例を示す概略説明図であ 10

【図12】本発明の第5の実施例を示す概略構成図であ

【図13】(a)、(b)は本発明の第5の実施例を示 す概略構成図である。

【図14】従来例の投射型表示装置の概略構成図であ

【図15】従来例の投射像を重ね合わせる機能をもつ投 射型表示装置の概略構成図である。

【図16】本発明に関連する画素重畳の原理説明図であ 20 130…管体

【図17】本発明に関連する投写位置ずれ調整の説明図 である。

【符号の説明】

1a、1b、110、120…プロジェクタ 7…スクリーン

7a、7b、7c、7d…検査パターン表示領域

8a、8b…くさび形透明基板

9a、9b、9c、9d、9e、9f…圧電素子

10…イメージセンサ出力信号

10a、10b…光学ステージ

11、12…光源

11a、11b、11c、11d…変位センサ

20a~20f…表示位置調整機構部を構成するアクチ ュエータ

21、22…光源から発生する赤外線、紫外線をカット するフィルター

31、32…光学フィルター

41、42…集光レンズ

50…変位量解析部

50a~50c…変位量を算出する回路

51、52…ライトバルブ

60…イメージセンサ

61、62、61a、62b、800…投射レンズ

11

81、82…光シフト素子

91、92…調整用信号

100a、100b…光学素子

102a、102b、102c、102d…平板透明基

103…透明液体

104…蛇腹構造のシール部材

105a、105b…結合子

106…駆動アーム

107…マイクロメーター

108…駆動器

110a、110b、110c、111、112…反射 ミラー

200…x z ステージ用台座

210、220…表示位置調整機構部

300…x 軸台座

310、320…合成映像信号発生部

400…2軸台座

410、420…検査信号発生部

500a、500b…駆動用モーター

600a、600b···ラック

700a、700b…ピニオン

30 810、820…映像信号

1000…垂直同期信号

2000a、2000b…検査信号発生部起動信号

3000…映像信号波形

4000…検査信号波形

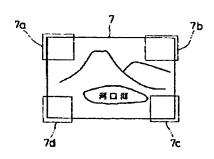
5000a、5000b…合成信号波形

6000a、6000b…イメージセンサ起動信号波形

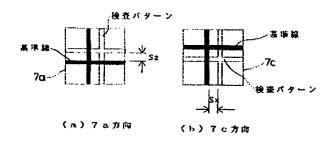
m1、m2…プロジェクタの光軸

m11、m12…プロジェクタの光線

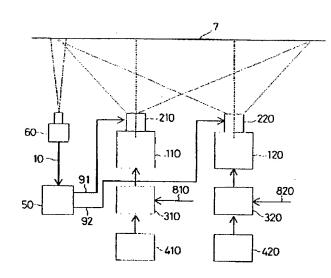
【図2】



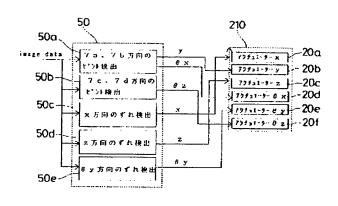
[図3]



【図1】



【図4】



7…スクリーン

10…イメージセンサ山力信号

50…変位量解析部

60…イメージセンサ

91, 92…關整用信号

110.120…プロジェクタ部

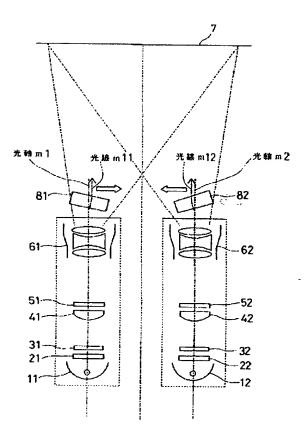
210,220…表示位置調整機構部

310.320…合成映像信号発生部

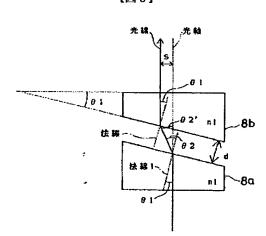
4 1 0. 4 2 0…檢查信号発生部

8 1 0, 8 2 0…映像信号

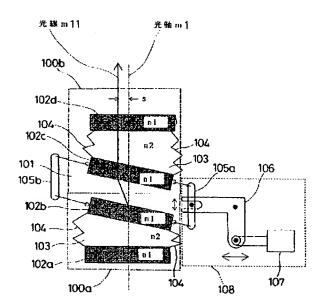
【図6】



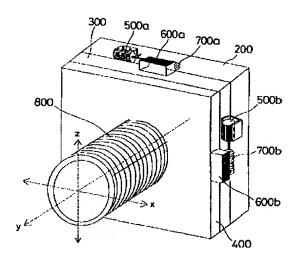
[図5]



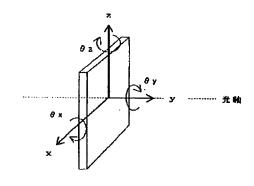




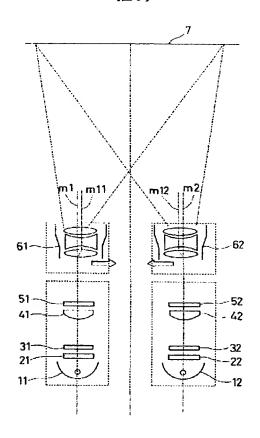
【図9】



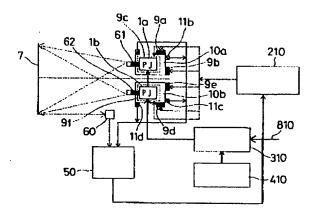
[図17]



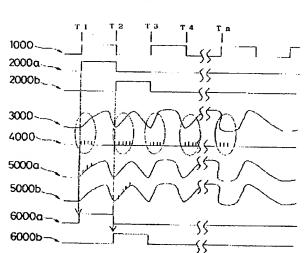
【図8】



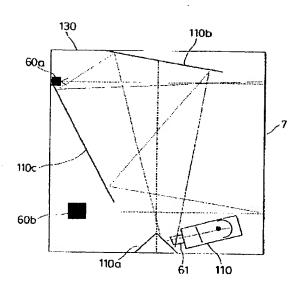
【図10】



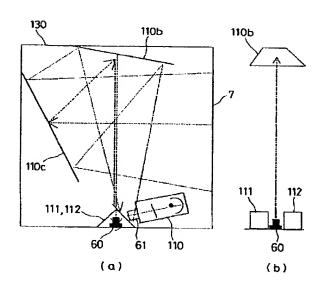
【図11】

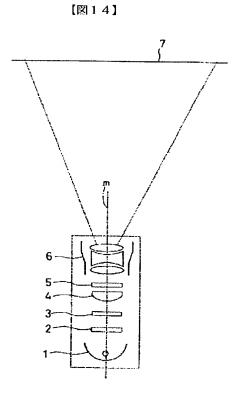


【図12】

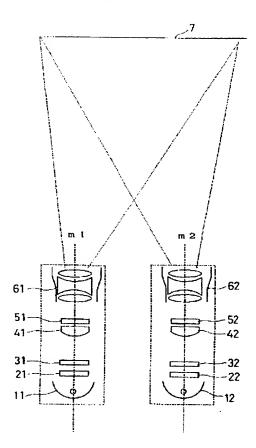


【図13】





【図15】



[図16]

